

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
30. März 2023 (30.03.2023)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2023/046502 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation:
G21K 1/00 (2006.01)
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2022/075085
- (22) Internationales Anmeldedatum:
09. September 2022 (09.09.2022)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
10 2021 124 396.3
21. September 2021 (21.09.2021) DE
- (71) Anmelder: **BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,
VERTRETEN DURCH DAS BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ENERGIE,
DIESES VERTRETEN DURCH DEN PRÄSIDENTEN**

- TEN DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT** [DE/DE]; Bundesallee 100, 38116 Braunschweig (DE).
- (72) Erfinder: **RAUPACH, Sebastian**; Tiergarten 66, 38116 Braunschweig (DE).
- (74) Anwalt: **GRAMM, LINS & PARTNER PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTGMBB**; Frankfurter Straße 3c, 38122 Braunschweig (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY,

(54) Title: ION SURFACE TRAP, AND METHOD FOR OPERATING AN ION SURFACE TRAP

(54) Bezeichnung: IONEN-OBERFLÄCHENFALLE UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER IONEN-OBERFLÄCHENFALLE

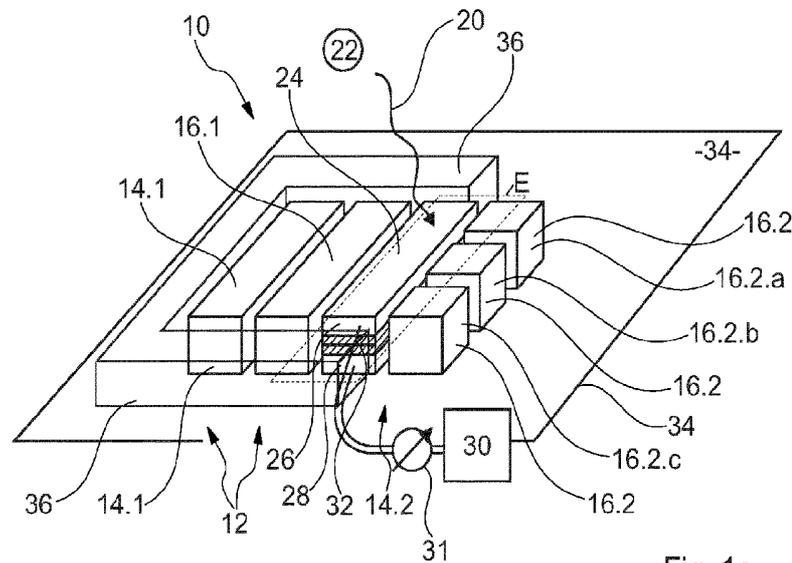


Fig. 1a

WO 2023/046502 A1

(57) **Abstract:** The invention relates to an ion surface trap (10) comprising (a) an electrode pair (12) having a first trap electrode (14.1) and a second trap electrode (14.2) and configured for forming a trap volume for at least one ion (22) when an electrical AC voltage is applied, (b) at least two DC voltage electrodes (16) arranged for terminating the trap volume and/or generating an electric field enabling an ion position of an ion (22) trapped in the ion surface trap (10) to be varied relative to the ion surface trap (10), and (c) a sensor for detecting photons (20) emitted by the at least one ion (22), wherein (d) the sensor is an energy-sensitively measuring superconductor sensor (18) having a superconductor layer/separating layer/superconductor layer structure, and (e) at least the first superconductor layer (24, 28) forms the first trap electrode (14).

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft eine Ionen-Oberflächenfalle (10) mit (a) einem Elektrodenpaar (12), das eine erste Fallen-Elektrode (14.1) und eine zweite Fallen-Elektrode (14.2) aufweist und das ausgebildet ist zum Bilden eines Fallenvolumens für zumindest ein Ion (22) beim Anlegen einer elektrischen Wechselspannung, (b) zumindest zwei Gleichspannungselektroden (16), die angeordnet sind zum Abschließen des Fallenvolumens und/oder Erzeugen eines elektrischen Felds, mittels dem eine Ionen-Position



MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST,
SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

eines in der Ionen-Oberflächenfalle (10) gefangenem Ions (22) relativ zur Ionen-Oberflächenfalle (10) veränderbar ist, und (c) einem Sensor zum Erfassen von Photonen (20), die vom zumindest einen Ion (22) ausgesendet werden, wobei (d) der Sensor ein energisensitiv messender Supraleiter-Sensor (18) ist, der eine Supraleiterschicht-Trennschicht-Supraleiterschicht-Struktur hat und (e) mindestens die erste Supraleiterschicht (24, 28) die erste Fallen-Elektrode (14) bildet.

Ionen-Oberflächenfalle und Verfahren zum Betreiben einer Ionen-Oberflächenfalle

Die Erfindung betrifft eine Ionen-Oberflächenfalle mit (a) einem Elektrodenpaar, das eine erste Fallen-Elektrode und eine zweite Fallen-Elektrode aufweist und das ausgebildet ist zum Bilden eines Fallenvolumens für zumindest ein Ion beim Anlegen einer elektrischen Wechselspannung, (b) zumindest zwei Gleichspannungselektroden, die angeordnet sind zum Abschließen des Fallenvolumens und/oder Erzeugen eines elektrischen Felds, mittels dem eine Ionen-Position eines in der Ionen-Oberflächenfalle gefangenen Ions relativ zur Ionen-Oberflächenfalle veränderbar ist, und (c) einem Sensor zum Erfassen von Photonen, die von zumindest einem Ion ausgesendet wurden.

10

Derartige Ionen-Oberflächenfallen werden dazu verwendet, ein Ion, zwei Ionen oder mehrere (also 3, 4, 5, ..., N) Ionen in einem vorgegebenen Raumgebiet zu halten. Beispielsweise wird eine Ionen-Oberflächenfalle in einer Atomuhr oder einem Quantencomputer verwendet. Eine Atomuhr und/oder ein Quantencomputer mit einer erfindungsgemäßen Ionen-Oberflächenfalle sind ebenfalls Gegenstände dieser Erfindung.

15

Ionen-Oberflächenfallen werden häufig auf einem Chip realisiert. Zum Detektieren von Licht, das von dem Ion ausgesandt wird, werden spezielle Sensoren auf dem Chip angeordnet, wie beispielsweise im Artikel „State Readout of a Trapped Ion Qubit Using a Trap-Integrated Superconducting Photon Detector“ von Todaro et al., Phys. Rev. Lett. (2021) beschrieben ist.

20

Aus dem Artikel “State readout of a trapped ion qubit using a trap-integrated superconducting photon detector” von Todaro et al in Physical Review Letters, Vol. 126 2021 No 1 ist eine gattungsgemäße Ionen-oberflächenfalle bekannt, mit der

25

Qubits ausgelesen werden können. Zwischen dem Ion und dem Detektor befinden sich keine optischen Elemente, sodass die Ionen-Fluoreszenz verwendet werden kann, um die Quanteneffizienz des Detektors sowie deren Abhängigkeit von dem Inzidenzwinkel und der Inzidenzpolarisation zu messen.

5

Der Beitrag „UV-sensitive superconducting nanowire single photon detectors for integration in an ion trap“ von Slichter et al, in Optics Express, Vol. 25 2017 No. 8 S. 8705-8720 beschreibt einen Einzelphoton-Detektor, der in einer Paul-Falle mit planaren Radiofrequenz-Elektroden eingesetzt wird.

10

Das Paper „Fluorescence detection of a trapped ion with a monolithically integrated single-photon-counting avalanche diode“ von Setzer et al, in: arXiv: 2105.01235v2 [quant-ph], vom 07.07.2021 (S 1-6) DOI: 10.48550/arXiv.2105.01235 zeigt eine gattungsgemäße Ionen-oberflächenfalle zur Detektion von Fluoreszenz-Licht eines in einer Falle gefangenen Ions unter Verwendung von Einzelphoton-Lawinenfotodioden, die zusammen mit einer Oberflächen-Ionenfalle auf einem Chip integriert sind.

15

Die DE 10 2019 114 842 A1 beschreibt eine Ionenfalle zum Halten von zumindest einem Ion in einem Raumbereich zu halten, der durch ein ponderomotives Potential definiert ist. Elektroden einer Elektrodenstruktur, die um den Raumbereich herum angeordnet ist, werden so angesteuert, dass Ionen in der Ionenfalle von einem Laserstrahl erfasst werden.

20

Aus der DE 10 2018 121 942 B3 ist eine Ionenfalle bekannt, die zwei Elektroden aufweist, die dazu ausgebildet sind, ein elektrisches Feld zu erzeugen, das zumindest in einem Bereich ein attraktives ponderomotives Potential umfasst. Ein elektrischer Resonator versorgt Elektroden der Ionenfalle mit Wechselspannung und weist einen Schwingkreis auf, der innerhalb der Vakuumkammer angeordnet ist. Dadurch kann das Wechselspannungsfeld der Ionenfalle leichter kalibriert werden.

25

30

Die US 6 710 334 B1 beschreibt ein Quadrupol-Ionenfallen-Massenspektrometer mit für große Moleküle durch Verwendung kryogener Teilchendetektoren als Moleküldetektoren. Kryogene Teilchendetektoren haben eine massenunabhängige Detektionseffizienz und zeigen keine Abnahme der Detektionseffizienz bei

zunehmender Molekülmasse im Vergleich zu ionisierenden Detektoren, die in herkömmlichen Quadrupol-Ionenfallen-Massenspektrometern verwendet werden.

In der US 5 994 694 A ist ein Ultrahochmassen-Flugzeitmassenspektrometer, das
5 einen kryogenen Teilchendetektor als Ionendetektor verwendet. Durch den Kryodetektor wird Leistung und Empfindlichkeit verbessert. Es wird ein kryogen gekühlter Nb-Al₂O₃-Nb-Supraleiter-Isolator-Supraleiter (SIS)-Tunnelübergang-Detektors verwendet, der bei 1,3 K arbeitet. Der STJ-Detektor hat die Fähigkeit zur Ladungsunterscheidung. Da der kryogene STJ-Detektor auf die Ionenenergie anspricht und nicht
10 auf die Erzeugung von Sekundärelektronen angewiesen ist, kann er große Molekülonen mit einer geschwindigkeitsunabhängigen Effizienz von nahezu 100 % erkennen.

Der Artikel „Quasiparticle trapping and the quasiparticle multiplier“ von N.E. Boot, in:
15 Applied Physics Letters, Vol. 50 1987 No. 5, S. 293-295, ISSN 0003-6951 (P) beschreibt das detektieren von Phononen, elektromagnetischer Strahlung und Kernpartikeln mittels supraleitender Tunnelkontakte.

Die WO 2015/ 128 438 A1 beschreibt System mit einem Kryostaten und einer Oberflächenenektrodenfalle auf einem Siliziumsubstrat. Auf dessen Vorderseite befinden
20 sich planare Elektroden, die so konfiguriert sind, dass sie ein Einfangpotenzial erzeugen. Eine erste Hochfrequenzelektrode erstreckt sich parallel zur Vorderseite des Substrats, eine Gleichstromelektrode parallel zur Vorderseite und grenzt an die erste Hochfrequenzelektrode an und von dieser elektrisch isoliert. Die Oberflächenenektrodenfalle ist im Kryostaten angeordnet, der die Oberflächenenektrodenfalle auf
25 höchstens 150 K kühlt.

Es hat sich als sehr aufwendig herausgestellt, beispielsweise Fluoreszenzstrahlung, die von dem Ion ausgesandt wird, zu detektieren.

30

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das Detektieren von Photonen, die von dem gefangenen Ion ausgesandt werden, zu verbessern.

Die Erfindung löst das Problem durch eine gattungsgemäße Ionen-Oberflächenfalle,
35 bei der der Sensor ein energiesensitiv messender Supraleiter-Sensor ist, der eine

Supraleiterschicht-Trennschicht-Supraleiterschicht-Struktur hat und bei dem zumindest eine der Supraleiterschichten zumindest die erste Fallen-Elektrode und/oder Gleichspannungselektrode bildet.

- 5 Die Erfindung löst das Problem zudem durch ein Verfahren zum Betreiben einer solchen Ionen-Oberflächenfalle, das die folgenden Schritte aufweist: (i) Einbringen eines Ions in die Ionen-Oberflächenfalle, (ii) Anlegen einer Gleichspannung an die Gleichspannungselektroden, sodass das Ion in der Ionen-Oberflächenfalle gefangen bleibt, und (iii) Detektieren zumindest eines Photons, das vom Ion abgegeben wurde,
10 mittels des Sensors.

Vorteilhaft an der Erfindung ist, dass vom Ion abgegebene Strahlung nur einen kurzen Weg zurücklegen muss, um vom Sensor erfasst zu werden und keine optischen Elemente wie optische Fenster, Linsen, Glasfasern etc. durchqueren muss. Die
15 Wahrscheinlichkeit, auf dem Weg vom Ion zum Sensor absorbiert zu werden, ist daher gering.

Aufgrund der räumlichen Nähe des Sensors zum gefangenen Ion kann der Sensor zudem Photonen in einem vergleichsweise weiten Raumwinkelbereich detektieren.
20 Durch den erfindungsgemäßen Aufbau kann der Sensor zudem eine vergleichsweise große räumliche Ausdehnung besitzen und so einen noch größeren Raumwinkelbereich abdecken, als wenn er auf den Raum zwischen den Elektroden beschränkt wäre.

25 Günstig ist zudem, dass die Erfindung in der Regel eine höhere Integrationsdichte erlaubt. Alternativ oder zusätzlich ergibt sich, insbesondere bei einer Reihenfertigung, eine vereinfachte Herstellung.

Die Erfindung basiert insbesondere auf der Idee, die aus dem Stand der Technik
30 bekannte Trennung von Sensor und Fallen-Elektrode aufzuheben. In anderen Worten bildet zumindest eine Fallenelektrode einen Teil der Struktur, die der Detektion einzelner Photonen dient.

Zwischen den beiden Supraleiterschichten herrscht vorzugsweise eine konstante
35 Potentialdifferenz. Das Potenzial der beiden Supraleiterschichten oszilliert jedoch

vorzugsweise. Beispielsweise oszilliert das Potential gegenüber einem Nullpotential einer Spannungsquelle, die ausgebildet ist zum Anlegen einer gemeinsamen Spannung an beide Supraleiterschichten, mit einer Fallen-Frequenz, bei der es sich um eine Radiofrequenz handelt.

5

Wird – wie gemäß einer bevorzugten Ausführungsform vorgesehen – eine Gleichspannungselektrode verwendet, die aus zumindest zwei Teil-Elektroden besteht, kann zumindest eine dieser Teil-Elektroden als Sensor ausgebildet sein.

10 Im Rahmen der vorliegenden Beschreibung wird unter einer Supraleiterschicht eine Schicht eines Materials verstanden, die bei einer Temperatur unterhalb einer Sprungtemperatur supraleitend wird. Vorzugsweise ist die Supraleiterschicht aus einem Hochtemperatur-Supraleiter aufgebaut. Günstig ist es, wenn der Hochtemperatur-Supraleiter eine Sprungtemperatur oberhalb von 77 Kelvin hat.

15

Unter dem Elektrodenpaar wird die Gesamtheit aus der ersten Fallen-Elektrode und der zweiten Fallen-Elektrode verstanden. Es ist möglich, nicht aber notwendig, dass zumindest eine der Fallen-Elektroden aus 2, 3 oder mehr Teil-Elektroden aufgebaut ist. Es ist zudem möglich, nicht aber notwendig, dass einzelne Teil-Elektroden

20 gegeneinander elektrisch isolierte sind. Alternativ sind die einzelnen Teil-Elektroden miteinander elektrisch kontaktiert, sodass sie auf dem gleichen Potenzial liegen.

Wird an das Elektrodenpaar die Fallen-Frequenz angelegt, bildet sich ein Fallenvolumen. Das Fallenvolumen ist derjenige Raumbereich, den das Ion nicht verlassen

25 kann.

Unter den Gleichspannungselektroden werden solche Elektroden verstanden, mittels denen ein statisches elektrisches Einschlussfeld erzeugt werden kann. Das Einschlussfeld ist vorzugsweise so ausgebildet, dass das Fallenvolumen in alle

30 Raumrichtungen geschlossen ist.

Günstig ist es, wenn eine Supraleiterschicht-Dicke der Supraleiterschicht zwischen 5 nm und 500 nm liegt.

Bei der Trennschicht handelt es sich um eine Schicht, die ihrerseits aus mehreren Teilschichten aufgebaut sein kann. Günstig ist es, wenn die Trennschicht eine Trennschicht-Dicke zwischen 1 nm und 100 nm hat.

- 5 Der Sensor ist so ausgebildet, dass dann, wenn ein Photon auf die erste Supraleiterschicht oder die zweite Supraleiterschicht trifft, Cooper-Paare getrennt werden und freie Elektronen entstehen, die durch die Trennschicht tunneln und einen Stromimpuls bewirken. Diese Stromimpuls kann detektiert und daraus die Energie des Photons berechnet werden.

10

Günstig ist es, wenn die Ionen-Oberflächenfalle auf einem Chip realisiert ist. Insbesondere sind das Elektrodenpaar, die Gleichspannungselektroden und der Sensor integrale Bestandteile des Chips. Die genannten Strukturen sind insbesondere durch sukzessives Abscheiden verschiedener Schichten aufeinander und/oder Herausätzen von Teilen der Schichtstruktur hergestellt.

15

Günstig ist es, wenn die Trennschicht eine Isolatorschicht ist, die zwischen den Supraleiterschichten angeordnet ist.

- 20 Vorzugsweise besitzt die Ionen-Oberflächenfalle eine Spannungsquelle, die so mit den Supraleiterschichten verbunden ist, dass zwischen den beiden Supraleiterschichten eine konstante Potentialdifferenz besteht.

- 25 Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform besitzt die Ionen-Oberflächenfallen einen Tunnelstromänderungsdetektor zum, insbesondere quantitativen und/oder zeitaufgelösten, Detektieren einer Tunnelstromänderung eines Tunnelstroms von der ersten Supraleiterschicht durch die Trennschicht in die zweite Supraleiterschicht.

- 30 Vorzugsweise ist die Isolatorschicht so angeordnet, dass der Tunnelstromänderungsdetektor eine Tunnelstromänderung detektiert, wenn mindestens ein Photon auf eine der Supraleiterschichten oder die Trennschicht trifft.

Unter dem Tunnelstromänderungsdetektor wird ein Detektor verstanden, mit dem eine Änderung des Tunnelstroms detektierbar ist. Insbesondere ist ein Tunnelstrommessgerät, mittels dem der Tunnelstrom gemessen werden kann, gleichzeitig ein Tunnelstromänderungsdetektor.

5

Günstig ist es, wenn die Trennschicht eine oder mehrere kleinvolumige Sammel-Schichten aus einem – zusätzlich zu den äußeren supraleitenden Schichten des Sensors - weiteren supraleitenden Material aufweist, dessen Cooper-Paar-Bindungsenergie, und damit dessen Energielücke im Einzelelektronenenergieschema in der Nähe der Fermikante, geringer ist als die des weiter außen liegenden supraleitenden Materials. Auf diese Weise können Quasiteilchen, die in der Sammelschicht in einen etwas niedrigeren Energiezustand übergegangen sind, nicht ohne Weiteres in den äußeren Supraleiter mit größerer Energielücke übergehen und dort abfließen, siehe N. E. Booth: „Quasiparticle trapping and the quasi particle multiplier“, Appl. Phys. Lett. 50, 293 (1987). Die Trennschicht ist damit vorzugsweise so aufgebaut, dass in die Trennschicht diffundierende Elektronen und/oder Quasiteilchen sich dort anreichern und eine Signalerhöhung des Supraleiter-Sensors bewirken, indem sie mehrfach für Tunnelprozesse durch die Trennschicht zur Verfügung stehen und so mehrfach zum Gesamtsignal beitragen.

20

Günstig ist es, wenn die Ionen-Oberflächenfalle ein Substrat besitzt, auf das die erste Fallen-Elektrode und die zweite Fallen-Elektrode, die erste Supraleiterschicht, die zweite Supraleiterschicht und die Trennschicht aufgebracht sind. Es sei darauf hingewiesen, dass darunter nicht zwingend verstanden wird, dass die entsprechende Struktur, wie beispielsweise die erste Fallen-Elektrode, direkt auf das Substrat aufgebracht ist. Es ist vielmehr auch möglich, dass eine der genannten Strukturen auf eine andere der genannten Strukturen aufgebracht wird, die ihrerseits mittelbar oder unmittelbar dem Substrat verbunden ist. Maßgeblich ist lediglich, dass die erste Fallen-Elektrode, die zweite Fallen-Elektrode, die erste Supraleiterschicht, die zweite Supraleiterschicht und die Trennschicht vorzugsweise eine einstückige Einheit mit dem Substrat bilden.

30

Bei dem Substrat kann es sich beispielsweise um einen Halbleiter, Quarzglas oder Korund handeln. Andere Substratmaterialien sind möglich.

35

Günstig ist es, wenn die zweite Supraleiterschicht elektrisch gegenüber der ersten Supraleiterschicht isoliert und potentialgetrennt ist. Unter dem Merkmal, dass die zwei Supraleiterschichten potentialgetrennt sind, wird insbesondere verstanden, dass diese gegeneinander isoliert und nicht miteinander kontaktiert sind. Es ist daher
5 möglich, dass die beiden Supraleiterschichten auf unterschiedlichen elektrischen Potenzialen liegen. Das ist beispielsweise bei Nanodrähten anders, die vollständig auf einem Potenzial relativ zu einem Gegelement liegen müssen, wobei das Gegelement auf dem gleichen Potenzial wie eine der Fallen-Elektroden liegt.

- 10 Vorzugsweise ist die Spannungsquelle ausgebildet und kontaktiert zum Anlegen einer gemeinsamen Spannung an beide Supraleiterschichten. Die gemeinsame Spannung ist vorzugsweise eine Wechsellspannung, wenn mindestens eine der Fallenelektroden als Photonen-Detektor ausgebildet ist. Die gemeinsame Spannung ist vorzugsweise eine Gleichspannung, wenn mindestens eine der
15 Gleichspannungselektroden als Photonen-Detektor ausgebildet ist.

Vorzugsweise ist die Spannungsquelle so ausgebildet und mit den Supraleiterschichten verbunden, dass eine Potentialdifferenz zwischen beiden Supraleiterschichten zeitlich konstant ist. Hierunter wird insbesondere verstanden, dass eine Potentialdifferenz so klein ist, dass die Schwankung einen Unsicherheitsbeitrag von höchstens
20 50% zur Gesamtunsicherheit der Messung der Tunnelstromänderung leistet. Vorzugsweise schwankt die Potentialdifferenz um höchstens ein Prozent pro Sekunde.

- 25 Wenn die Spannungsquelle – wie gemäß einer bevorzugten Ausführungsform vorgesehen – eine Wechsellspannungsquelle ist, besitzt sie vorzugsweise ein Hochpassfilter, an den eine oder mehrere Wechsellspannungsquellen mit derselben Frequenz angeschlossen sind.

- 30 Die Ionen-Oberflächenfalle besitzt vorzugsweise einen Magnetfelderzeuger, der ein Magnetfeld in einer Trennschicht-Ebene der Trennschicht erzeugt. Insbesondere ist dadurch ein Hintergrund-Tunnelstrom unterdrückbar.

Sollen mehrere Ionen in der Ionen-Oberflächenfallen gefangen werden, was einen
35 bevorzugten Ausführungsform darstellt, ist es vorteilhaft, wenn zumindest mit einer

hinreichend hohen Wahrscheinlichkeit ermittelt werden kann, von welchem Ion ein Photon stammt, das vom Supraleiter-Sensor detektiert wird. Günstig ist es deshalb, wenn zumindest eine der Supraleitungsschichten zumindest zwei voneinander räumlich getrennte und gegeneinander elektrisch isolierte Detektionsabschnitte aufweist.

5

Günstig ist es, wenn die Detektionsabschnitte so mit dem Tunnelstromänderungsdetektor verbunden sind, dass ein Auftreffort des Photons ermittelbar ist. Unter dem Merkmal, dass der Auftreffort des Photons ermittelbar ist, wird insbesondere verstanden, dass mit einer Sicherheit von zumindest 75%, insbesondere zumindest 85%,
10 beispielsweise zumindest 90%, ermittelt werden kann, von welchem Ion ein detektiertes Photon stammt.

Vorzugsweise besitzt die Ionen-Oberflächenfalle einen Verdampfer zum Erzeugen eines Gases aus Teilchen eines chemischen Reinstoffs, beispielsweise eines
15 Metalls, insbesondere eines Alkalimetalls, und einen Photoionisator zum Ionisieren von Metallatomen, insbesondere Alkalimetallatomen, sodass daraus Ionen entstehen. Der Photoionisator besitzt vorzugsweise eine Elektrodenanordnung und eine Ansteuereinheit, die mit der Elektrodenanordnung so verbunden ist, dass die erzeugten Ionen einzelnen in die Ionen-Oberflächenfalle einbringbar sind.

20

Günstig ist es, wenn die Ionen-Oberflächenfalle eine Auswerteeinheit aufweist, die mit dem Tunnelstromänderungsdetektor verbunden ist. Die Auswerteeinheit ist vorzugsweise ausgebildet zum Durchführen eines erfindungsgemäßen Verfahrens.

25 Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens umfasst der Schritt des Einbringens eines Ions in die Ionen-Oberflächenfalle vorzugsweise die Schritte (i) Verdampfen eines Reinstoffs, beispielsweise von Metall, insbesondere eines Alkalimetalls, sodass ein Dampf entsteht, (ii) Photoionisieren des Dampfs, insbesondere von Metallatomen des Metaldampfs und (iii) Bewegen zumindest eines Ions des Dampfs in ein
30 Fallenvolumen der Ionen-Oberflächenfalle.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigt

- Figur 1 in der Teilfigur 1a eine schematische perspektivische Ansicht einer erfindungsgemäßen Ionen-Oberflächenfalle und
5 in der Teilfigur 1b einen Querschnitt durch das elektrische Potenzial, das beim Anlegen des elektrischen Wechselfelds an das Elektrodenpaar entsteht. Die beiden Kreuze zeigen die Richtung der Achse der normalen Moden $n_{\perp 1}$ und $n_{\perp 2}$.
- 10
- Figur 2 zeigt in der Teilfigur 2a ein Schaltbild der Spannungsquelle, die mit den beiden Supraleitungsschichten verbunden ist, gemäß einer ersten Ausführungsform und
15 in der Teilfigur 2b ein Schaltbild der Spannungsquelle, die mit den beiden Supraleitungsschichten verbunden ist, gemäß einer zweiten Ausführungsform.

Figur 1a zeigt eine Ionen-Oberflächenfalle 10 mit einem Elektrodenpaar 12, das eine erste Fallen-Elektrode 14.1 und eine zweite Fallen-Elektrode 14.2 umfasst. Die
20 Ionen-Oberflächenfalle 10 besitzt zudem zwei Gleichspannungselektroden 16.1, 16.2.

Mittels eines Supraleiter-Sensors 18 kann ein schematisch eingezeichnetes Photon 20 detektiert werden, das von einem ebenfalls schematisch eingezeichneten Ion 22 ausgesendet wurde. Die Gleichspannungselektroden 16.1, 16.2 sind mit einer nicht
25 eingezeichneten Positionier-Spannungsquelle verbunden, die ausgebildet ist zum Abgeben einer Spannung, sodass das Ion 22 an einer vorgegebenen Position P_{22} positioniert wird.

30 Der Supraleiter-Sensor 18 besitzt eine erste Supraleiterschicht 24, eine Trennschicht 26 und eine zweite Supraleiterschicht 28. Die erste Supraleiterschicht besteht beispielsweise aus Niob oder Tantal oder aus einem Hochtemperatursupraleiter, beispielsweise Yttriumbariumkupferoxid. Die Trennschicht 26 besteht vorzugsweise aus einem Isolator wie Aluminiumoxid und kann eine Sammelschicht beispielsweise

aus als Aluminium aufweisen Die zweite Supraleiterschicht besteht vorzugsweise aus demselben Material wie die erste Supraleiterschicht.

Figur 1a zeigt zudem eine Spannungsquelle 30, die mit den Supraleiterschichten 24, 5 26 verbunden ist. Die Spannungsquelle 30 beaufschlagt die erste Supraleiterschicht 24 mit einer ersten Wechselspannung $U_{w,24}$, die eine Fallen-Frequenz f_t hat, und die zweite Supraleiterschicht 26 mit einer zweiten Wechselspannung $U_{w,26}$, die ebenfalls die Fallen-Frequenz f_t hat. Eine Potentialdifferenz $\Delta U = |U_{w,24} - U_{w,26}|$ ist konstant und kleiner als die Energiebandlücke des verwendeten Supraleiters geteilt durch die 10 Elementarladung. Im Fall von Niob ergibt sich daraus beispielsweise eine geeignete Spannung von ca. 1 mV.

Zwischen den beiden Supraleiterschichten 24, 26 und damit durch die Trennschicht 26 fließt ein Tunnelstrom I_{26} , der von einem Tunnelstromänderungsdetektor 31 er- 15 fasst wird.

Schematisch ist eingezeichnet, dass die Trennschicht 26 eine Sammel-Schicht 32 aufweisen kann, die im vorliegenden Fall aus Aluminium besteht. Die Sammel-Schicht 32 ist nicht separat kontaktiert, sondern weist eine Kontaktfläche zum 20 Isolator und zur jeweiligen Supraleiterschicht auf.

Die Fallen-Elektroden 14.1, 14.2 und die Gleichspannungselektroden 16.1, 16.2 sind auf einem Substrat 34 angeordnet und beispielsweise durch sukzessiven Schichtaufbau und nachfolgendes Abätzen hergestellt.

25

Figur 1a zeigt zudem schematisch einen Magnetfelderzeuger 36 in Form eines Magneten, der ein Magnetfeld in einer Trennschicht-Ebene E und parallel zu ihr erzeugt. Die Trennschicht 26 erstreckt sich entlang der Trennschicht-Ebene E. Das Magnetfeld dient dazu, die Amplitude von intrinsischen Hintergrundströmen zu unterdrücken, 30 wie die des Josephson-Gleichstroms und geometrieabhängige Resonanzeffekte des Josephson-Wechselstroms, die in der Strom-Spannungs-Charakteristik zu spannungsabhängigen Spitzen des Gleichstroms führen (sog. „Fiske-Stufen“).

Figur 1b zeigt einen Querschnitt durch das Fallenpotenzial φ , das beim Anlegen des elektrischen Wechselfelds an das Elektrodenpaar 12 entsteht. Das Kreuz zeigt die erwartete Position des Ions.

- 5 Figur 1a zeigt, dass die Gleichspannungselektrode 16.2 aus, zwei, drei oder mehr, im vorliegenden Fall drei Teil-Elektroden 16.2.a, 16.2.b und 16.2.c, bestehen kann.

Figur 2a zeigt die Schaltung der Spannungsquelle 30, die drei Teil-Spannungsquellen 38.1, 38.2, 38.3 aufweist. Die Teil-Spannungsquellen 38.1, 38.3 geben jeweils
10 konstante Spannungen U_1 , U_2 ab. Die Teil-Spannungsquelle 38.2 gibt eine reine Wechselfeldspannung $U_3 = U_w$ mit der Fallen-Frequenz f_t ab. Die Spannungen beziehen sich jeweils auf das Potenzial des Substrats 34.

Figur 2b zeigt die Schaltung, wenn die zweite Supraleiterschicht 24 aus n (hier:
15 $n = 2$) Teil-Elektroden 24.1, 24.2 aufgebaut ist. In diesem Fall existieren n Tunnelstromänderungsdetektoren 31.1, 31.2, die jeweils eine der Teil-Elektrode 24.1, 24.2 kontaktieren. Jede Teil-Elektrode ist ein Detektionsabschnitt.

Die Spannungsquelle 30 besitzt n Teil-Spannungsquellen zum Abgeben einer jeweils
20 gleichen Gleichspannung $U_1 = U_2 = U_g$ und eine Teil-Spannungsquelle zum Abgeben der Wechselfeldspannung $U_4 = U_w$ mit der Fallen-Frequenz f_t der Gleichspannung.

Trifft das schematisch eingezeichnete Photon 20 beispielsweise auf die erste Teil-Elektrode 14.1, so bewirkt dies eine Änderung des Tunnelstroms I_{26} von der ersten
25 Teil-Elektrode 14.1 zur zweiten Supraleitungsschicht 28. Der Tunnelstromänderungsdetektor 31 besitzt vorzugsweise n Teil-Tunnelstromänderungsdetektoren, hier: die Teil-Tunnelstromänderungsdetektoren 31.1, 31.2. Die Änderung des Tunnelstroms von der ersten Teil-Elektrode 14.1 zur zweiten Supraleiterschicht 28 wird vom ersten Teil-Tunnelstromänderungsdetektor 31.1 erfasst.

30

Die Änderung des Tunnelstroms wird von einer schematisch eingezeichneten Auswerteeinheit 38, die mit dem Tunnelstromänderungsdetektor 31 verbunden ist, erfasst, die aus dem Tunnelstrom I_{26} die Energie des Photons 20 berechnet und den Zeitpunkt der Detektion registriert.

35

Bezugszeichenliste

- 10 Ionen-Oberflächenfalle
- 12 Elektrodenpaar
- 14.1, 14.2 Fallen-Elektrode
- 16.1, 16.2 Gleichspannungselektrode
- 18 Supraleiter-Sensor

- 20 Photon
- 22 Ion
- 24 erste Supraleiterschicht
- 24.1, 24.2 Teil-Elektroden
- 26 Trennschicht
- 28 zweite Supraleiterschicht

- 30 Spannungsquelle
- 31 Tunnelstromänderungsdetektor
- 31.1, 31.2 Teil-Tunnelstromänderungsdetektor
- 32 Sammel-Schicht
- 34 Substrat
- 36 Magnetfelderzeuger
- 38 Auswerteeinheit
- 38.1, 38.2, 38.3 Teil-Spannungsquelle

- ΔU Potentialdifferenz
- f_t Fallen-Frequenz
- E Trennschicht-Ebene
- U_g Gleichspannung
- U_w Wechselspannung

Patentansprüche

- 5 1. Ionen-Oberflächenfalle (10) mit
- (a) einem Elektrodenpaar (12), das
eine erste Fallen-Elektrode (14.1) und eine zweite Fallen-Elektrode (14.2)
aufweist und das ausgebildet ist zum Bilden eines Fallenvolumens für
zumindest ein Ion (22) beim Anlegen einer elektrischen
10 Wechselfspannung,
- (b) zumindest zwei Gleichspannungselektroden (16.1, 16.2), die angeordnet
sind zum Abschließen des Fallenvolumens und/oder Erzeugen eines
elektrischen Felds, mittels dem eine Ionen-Position eines in der Ionen-
Oberflächenfalle (10) gefangenen Ions (22) relativ zur Ionen-
15 Oberflächenfalle (10) veränderbar ist, und
- (c) einem Sensor zum Erfassen von Photonen (20), die vom zumindest einen
Ion (22) ausgesendet werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
- (d) der Sensor ein energiesensitiv messender Supraleiter-Sensor (18) ist, der
20 eine Supraleiterschicht-Trennschicht-Supraleiterschicht-Struktur hat
und
- (e) mindestens die erste Supraleiterschicht (24, 28) die erste Fallen-Elektrode
(14.1) bildet.
- 25 2. Ionen-Oberflächenfalle (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
- (a) die Trennschicht (26) eine Isolatorschicht ist, die zwischen den
Supraleiterschichten (24, 28) angeordnet ist,
- (b) eine Spannungsquelle (30), die so mit den Supraleiterschichten (24,28)
verbunden ist, dass sich eine konstante Potentialdifferenz (ΔU) zwischen
30 den Supraleiterschichten (24, 28) ergibt,

- (c) die Ionen-Oberflächenfalle (10) einen Tunnelstromänderungsdetektor (31) zum Detektieren einer Tunnelstromänderung eines Tunnelstroms (I_{26}) durch die Trennschicht (26) aufweist und
- (d) die Isolatorschicht so angeordnet ist, dass der Tunnelstromänderungsdetektor (31) eine Tunnelstromänderung detektiert, wenn ein Photon (20) auf eine der Supraleiterschichten (24, 28) oder die Isolatorschicht trifft.
- 5
3. Ionen-Oberflächenfalle (10) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
- (a) die Trennschicht (26) eine oder mehrere normalleitende Sammel-Schichten (32) aufweist und
- 10 (b) die Trennschicht (26) so aufgebaut ist, dass in die Trennschicht (26) diffundierende Elektronen sich dort anreichern und eine Signalerhöhung des Supraleiter-Sensors (18) bewirken.
- 15 4. Ionen-Oberflächenfalle (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
- (a) ein Substrat (34), auf das die erste Fallen-Elektrode (14.1) und die zweite Fallen-Elektrode (14.2), die erste Supraleiterschicht (24), die zweite Supraleiterschicht (28) und die Trennschicht (26) aufgebracht sind,
- 20 (b) wobei die zweite Supraleiterschicht (28) elektrisch gegenüber der ersten Supraleiterschicht (24) isoliert und potentialgetrennt ist und
- (c) wobei die zweite Fallen-Elektrode (14.2) gegenüber der ersten Fallen-Elektrode (14.1) isoliert und potentialgetrennt ist.
- 25 5. Ionen-Oberflächenfalle (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Spannungsquelle (30) ausgebildet ist zum Anlegen einer gemeinsamen Wechselspannung (U_w) an beide Supraleiterschichten (24, 28).
- 30 6. Ionen-Oberflächenfalle (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Magnetfelderzeuger (36), der ein Magnetfeld in einer Trennschicht-Ebene (E) der Trennschicht (26) erzeugt, sodass ein Hintergrund-Tunnelstrom unterdrückbar ist.

7. Ionen-Oberflächenfalle (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
- (a) zumindest eine der Supraleitungsschichten (24, 28) zumindest zwei voneinander räumlich getrennte und gegeneinander elektrisch isolierte Detektionsabschnitte (24.1, 24.2) aufweist und dass
- 5 (b) die Detektionsabschnitte (24.1, 24.2) so mit dem Tunnelstromänderungsdetektor (31) verbunden sind, dass ein Auftreffort des Photons (20) ermittelbar ist.
- 10 8. Ionen-Oberflächenfalle (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Auswerteeinheit (38), die ausgebildet ist zum automatischen Durchführen eines Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 10 oder 11.
- 15 9. Ionen-Oberflächenfalle (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Supraleiterschicht-Trennschicht-Supraleiterschicht-Struktur eine erste Supraleiterschicht (24), eine Trennschicht (26) und eine zweite Supraleiterschicht (28) aufweist.
- 20 10. Verfahren zum Betreiben einer Ionen-Oberflächenfalle (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Schritte:
- (i) Einbringen eines Ions (22) in die Ionen-Oberflächenfalle (10),
- (ii) Anlegen einer Gleichspannung an die Gleichspannungselektroden (16.1, 16.2), sodass das Ion (22) in der Ionen-Oberflächenfalle (10) gefangen
- 25 bleibt, und
- (iii) Detektieren zumindest eines Photons (20), das vom Ion (22) abgegeben wurde, mittels des Supraleiter-Sensors (18).
11. Verfahren zum Betreiben einer Ionen-Oberflächenfalle (10) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des Einbringen eines Ions (22) in die Ionen-Oberflächenfalle (10) die folgenden Schritte umfasst:
- (i) Verdampfen eines Reinstoffs, sodass ein Dampf entsteht,
- (ii) Photoionisieren des Dampfs und
- (iii) Bewegen zumindest eines Ions (22) des Dampfs in ein Fallenvolumen der
- 35 Ionen-Oberflächenfalle (10).

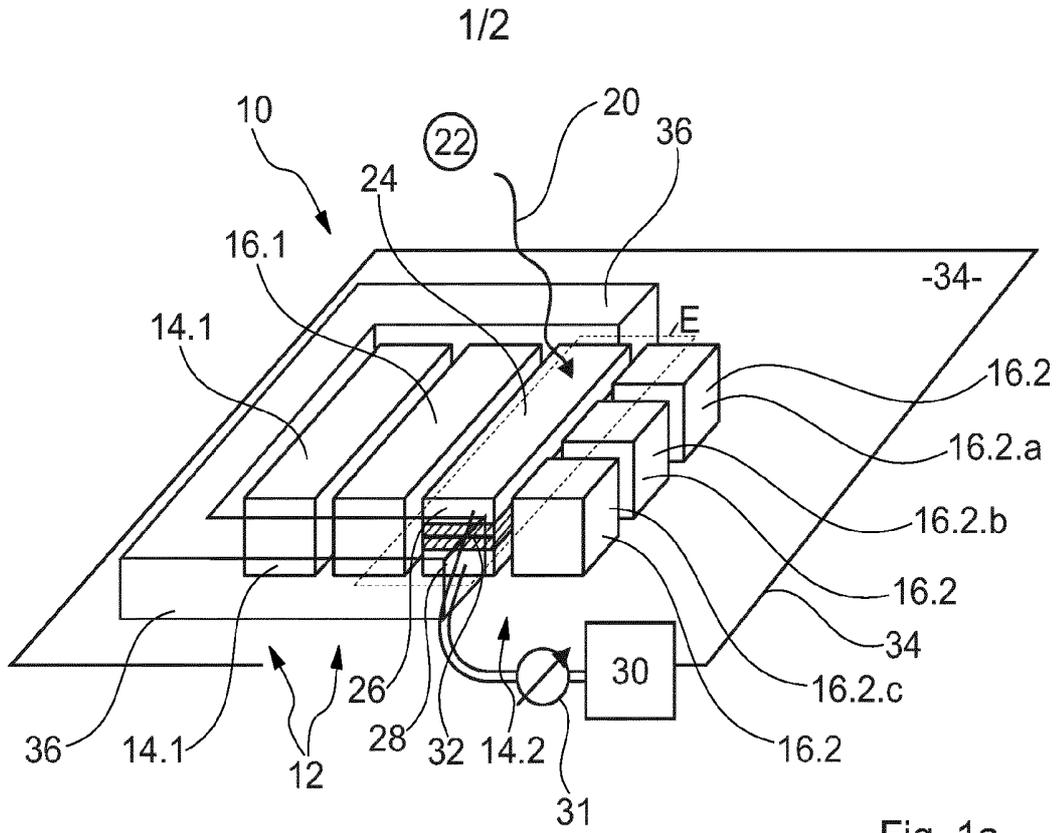


Fig. 1a

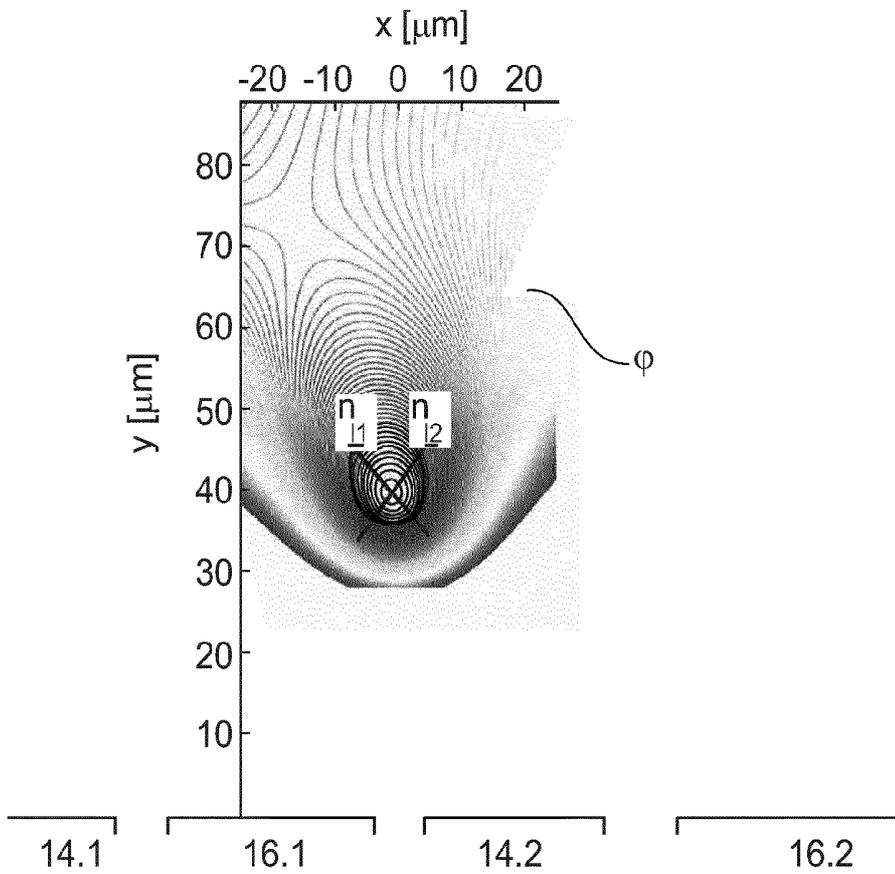


Fig. 1b

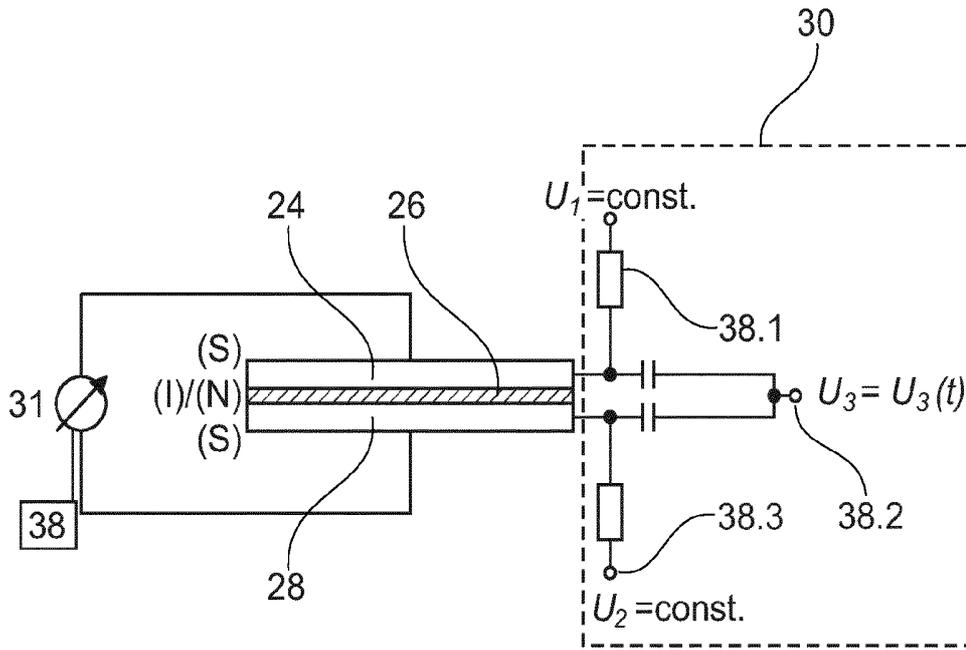


Fig. 2a

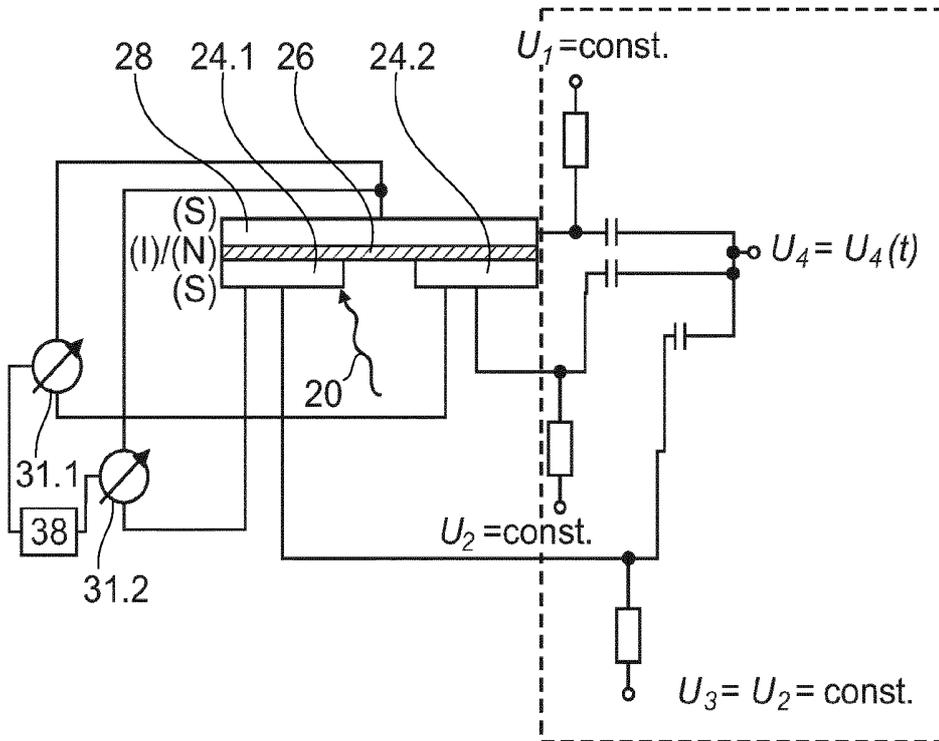


Fig. 2b

Fig. 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP2022/075085

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER <i>G21K 1/00(2006.01)i</i>		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G21K; H05G		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) EPO-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	TODARO S L ET AL. "State Readout of a Trapped Ion Qubit Using a Trap-Integrated Superconducting Photon Detector" <i>ARXIV.ORG, CORNELL UNIVERSITY LIBRARY, 201 OLIN LIBRARY CORNELL UNIVERSITY ITHACA, NY 14853</i> , 31 July 2020 (2020-07-31), XP081731684 page 1, column 2, line 26 - page 2, column 2, line 1; figure 1	1-11
A	JP 2012109295 A (NIPPON SIGNAL CO LTD; UNIV SAITAMA) 07 June 2012 (2012-06-07) paragraphs [0007], [0008], [0017]; figures 1a-6	1-11
A	CN 112885951 A (UNIV ELECTRONIC SCI & TECH CHINA) 01 June 2021 (2021-06-01) abstract; figures 1, 2	1-11
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 06 December 2022		Date of mailing of the international search report 21 December 2022
Name and mailing address of the ISA/EP European Patent Office p.b. 5818, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk Netherlands Telephone No. (+31-70)340-2040 Facsimile No. (+31-70)340-3016		Authorized officer Sewtz, Michael Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/EP2022/075085

Patent document cited in search report	Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
JP 2012109295 A	07 June 2012	JP 5669064 B2	12 February 2015
		JP 2012109295 A	07 June 2012
CN 112885951 A	01 June 2021	NONE	

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES		
INV. G21K1/00		
ADD.		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE		
Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) G21K H05G		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	TODARO S L ET AL: "State Readout of a Trapped Ion Qubit Using a Trap-Integrated Superconducting Photon Detector", ARXIV.ORG, CORNELL UNIVERSITY LIBRARY, 201 OLIN LIBRARY CORNELL UNIVERSITY ITHACA, NY 14853, 31. Juli 2020 (2020-07-31), XP081731684, Seite 1, Spalte 2, Zeile 26 - Seite 2, Spalte 2, Zeile 1; Abbildung 1 -----	1-11
A	JP 2012 109295 A (NIPPON SIGNAL CO LTD; UNIV SAITAMA) 7. Juni 2012 (2012-06-07) Absätze [0007], [0008], [0017]; Abbildungen 1a-6 -----	1-11
A	CN 112 885 951 A (UNIV ELECTRONIC SCI & TECH CHINA) 1. Juni 2021 (2021-06-01) Zusammenfassung; Abbildungen 1, 2 -----	1-11
<input type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
<p>* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :</p> <p>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</p> <p>"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</p> <p>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</p> <p>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</p>		<p>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</p> <p>"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung;; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</p> <p>"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung;; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist</p> <p>"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</p>
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absenddatum des internationalen Recherchenberichts
6. Dezember 2022		21/12/2022
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Sewtz, Michael

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2022/075085

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 2012109295 A	07-06-2012	JP 5669064 B2 JP 2012109295 A	12-02-2015 07-06-2012
-----	-----	-----	-----
CN 112885951 A	01-06-2021	KEINE	
-----	-----	-----	-----